This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-064267

(43) Date of publication of application: 12.04.1984

(51)Int.CI.

B24B 31/14

(21)Application number : 57-173954

(71)Applicant: MITSUBISHI HEAVY IND LTD

(22)Date of filing:

05.10.1982 (72)Inve

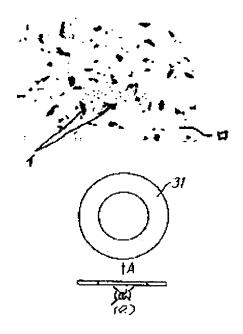
(72)Inventor: KOBAYASHI HIROSHI

NISHIKAWA KAZUO ISHII YASUHIRO

(54) METHOD OF SURFACE TREATMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable fine particles of hard materials to be embedded in the surface of a metal member when the surface of said metal member is subjected to abrasion resistance treatment, by barrel polishing said metal member requiring abrasion resistance by means of a barrel polishing abrasive mixed with said fine particles of hard materials. CONSTITUTION: A workpiece requiring abrasion resistance treatment, e.g., a ring valve 31 is barrel polished in a rotary barrel unit in which about 70% of a barrel abrasive consisting of an SiC material sintered into a pentahedron of 6W 15mm, and about 30% of approximately 600-grit SiC serving as fine particles of hard material, are thrown in together with 1I of water. Thereby, the fine particles (a) of SiC are embedded in the metal body (b) of the ring valve 31, greatly improving its abrasion resistance. As for the fine particles of hard materials, carbides such as B4C, TiC, VC, etc. or nitrides such as VN, ZrN, etc. are used besides the SiC.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭59—64267

⑤Int. Cl.³B 24 B 31/14

識別記号

庁内整理番号 7512-3C 43公開 昭和59年(1984) 4月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

外1名

剑表面処理方法

②特

願 昭57—173954

20出 願 昭57(1982)10月5日

仰発 明 者 小林弘

名古屋市中村区岩塚町字高道 1 番地三菱重工業株式会社名古屋 研究所内

仰発 明 者 西川和夫

名古屋市中村区岩塚町字高道1

番地三菱重工業株式会社名古屋 研究所内

70発 明 者 石井康博

名古屋市中村区岩塚町字高道 1 番地三菱重工業株式会社名古屋

研究所内

⑪出 願 人 三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5

番1号

⑭復 代 理 人 弁理士 内田明

明 細 割

1. 発明の名称 表面処理方法

2. 特許請求の範囲

耐摩耗性を必要とする金属部材の表面に便質 微粒子物質を均一に分散して埋込むことにより 前記部材表面に耐摩耗性を付与する方法におい て、前記便質数粒子物質をパレル研磨用の研誇 材と混合して前記部材をパレル研磨することを 特徴とする表面処理方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は金属部材の表面に耐摩耗性を付与する表面処理方法に関し、特に該部材の形状が単純なものから複雑なものまで容易に処理することのできる方法に関するものである。

耐摩耗性を付与する金属部材の表向硬化方法として各種の方法が開発されており、その一つの手法として特公昭55-8309号のように便質微粒子物質を耐摩耗性を必要とする部材の表面に埋め込み、その時の金属素地の加工硬化と表面に埋め込まれた便質微粒子物質によつて

耐摩耗性表面を得よりとするものがある。

この埋め込み方法は、ラン羽根を有するランプ工具を用い、硬質微粒子物質を油等の媒質に懸濁させたスラリーを、該ランプ工具に取付けた被処理部材の円筒状開孔表面とランプ羽根をの間に供給し、該被処理部材とランプ羽根を圧力下ですり合わせて被処理部材の円筒状開えを重加に硬質微粒子物質を埋め込もうとするものである。

しかし、この方法は、ピストンやシリンダー等のように円筒状開孔表面を有する単純な形状の部材には適するが、複雑な形状の部材には処理が行ない難い欠点を有している。

本発明は、上記の便質微粒子物質の埋め込みによる部材の耐暖耗性の良さに発目し、上記の欠点をなくしてどのような形状の部材にも適用できる表面硬化処理方法を提供すべくなされたものである。

すなわち本発明は耐摩耗性を必要とする金属 部材の表面に硬質数粒子物質を均一に分散して

時開昭59-64267(2)

埋込むことにより前記部材設血に耐寒耗性を付与する方法において、前記使質微粒子物質をバレル研磨用の研磨材と混合して前記部材をバレル研磨することを特徴とする装面処理方法に関するものである。

本発明方法は、シリンダー、ピストンシリンダー、シャフト、軸受、ピン、冷凍機の圧縮設用弁および弁座、ガイド、控動ベッド等の耐摩耗性を必要とする部材に適用することができる。以下、具体例をあげて本発明方法を詳細に説明する。

第1図(a)~(d)は冷凍圧縮機や空気圧縮機に用いられる弁形状の代表例を示す図で、第1図(a)~(d)はそれぞれのA矢視図である。

第2図はリング弁と称される円形環状弁使用の弁機構の主要制造を示す図で、冷凍圧確後や空気圧縮機に用いられる代表的弁機構である。

第2図中、1は吸入弁、2は吐出弁で、これ 5の弁に第1図回~回に示すような形状の弁が 使用される。3は吸収弁座、4 および9は吐出

13Cr 系のステンレス網等の強靱網で疲労強度の高い材料が用いられている。吸入弁と吐出弁は、ピストンの上下(クランク軸の1回転に対し1回の上下動があり、普通は800~3600 I 中の程度で使用される)勘問で、それぞれ開閉され、吸入弁は吸入弁座に、吐出弁は吐出弁座に衝線的に接触するため、圧縮機の運転中に繰返し接触し、弁は弁座のシート面の形状が転写されたように際耗する。この場合、原耗が微しい時は弁の肉厚がなくなる程である。

本発明は、とのような際耗を防止するために、 弁の表面に硬質微粒子粉末を埋め込んで、弁衷 面の耐際耗性を得る方法に関するものである。

次に、本発明方法の一実施例について説明する。

実施例 1

第1図(a)に示す戦状弁31(厚さ1.2 mm、材質 13Cr 1Mo系ステンレス鋼)を所定の形状、寸法に仕上げる。一方、内容積36との回転式パレル機にパレル研贈用の研贈材として6~15

弁准、5 はシリンダープロック、6 は吐出弁の変位量を規制する吐出弁押え、7 は吸入弁押えパネ、8 は吐出弁押えパネ、1 0 はパルプシート押えポルト、1 1 はナットを示す。

第3図はリード弁の弁機構の主要構造を示す 図で、該リード弁も冷凍圧構成や空気圧縮機に 用いられる。

席3図中、21は吸入弁、22は吐出弁で、 これらの弁に第1図(b),(d)に示すようを形状の 弁が使用される。23は弁板、24はリテーナ を示し、それぞれ図示省略の手段で組立てられ ており、25はシリンダー、26は吐出穴、27 は吸入穴を示す。

第2、3図に示すように、弁は1気筒に吸入 弁と吐出弁があり、吸入弁は圧縮機の吸入時に 開き、吐出弁は閉じている。また圧縮時には吸入 入弁は閉じており、シリンターの内圧が或る一 定の圧力に達すると、吐出弁が開いて圧縮され た媒体(冷媒や空気等)が吐出し瞬間的に又閉 じる機構を有している。弁は一般に、高炭紫癜

mmの5 簡体に嫌結した Sic 材を容器の7 0 %程度投入し、ここに硬質 敬粒子物 複として 600mm 程度の粒度の Sic を水 1 L に懸濁させてたものを磁加、混合する。このパレル研磨用研磨材+硬質微粒子物質中へ上記の環状弁を入れ、パレルの回転数を3 4 r.p. m.で回転させながら 120分のパレル研磨を行う。

このようにして表面処理された環状弁31の表面状況は第4図の顕微鏡写真に示す通りであり、またこの所面状況は第5図の複数鏡写真に示す通りである。第4,5図中、イが金属素池中に埋込まれたSic 微粒子である。

この間状介31の両面を軽くランピング後、多気筒冷凍圧縮線へ弱み込み、冷凍電用のシステムとして組み上げて約10000時間運転後の状況を調べたところ、弁の故厚12mmに対し、て無処理弁では02~08mmの學耗が発生していたが、上記の本治明方法による処理を施した弁では0055mm以下の學能であつた。

奖 施 例 2

特開昭59-64267(37)

2 サイクル用ピストンリング(鶏鉄製)に対して、6 角形の速心流動パレル研磨装置を用いて、4 ~ 8 mmの 5 面体に焼結した SiC 研磨材に、3 8 0 * の SiC 硬質微粒子物質を媒体の重量比で 5 %混合し、約 1 5 分間パレル研磨し、2 サイクルエンジンへ組込み、3 3 0 0 r.p.mで 1 0 0 時間の負荷運転を行なつたところ、紡鉄のままのものに比し、原粧が少なく、良好な結果が得られた。

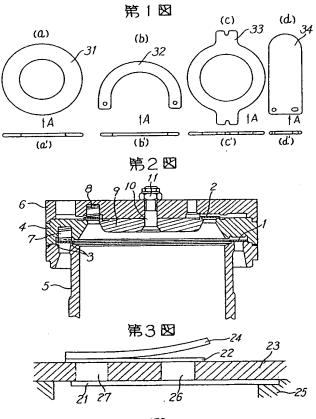
本発明方法は、以上の実施例に示すパレル研解用研解材の他、通常のパレル研磨に使用される各種の材質、形状、寸法のものが適用でき、被処理物の材質、形状、大きさ等により適宜選択される。またパレルの方法も以上の実施例に示すものの他に組みのものが適用できる。 畑め込む磁粒子は、できる限り硬質で、上配の SiC (Hy ÷ 2 5 0 0 0)、 VC (Hy ÷ 2 8 0 0)、 HfC(Hy ÷ 2 4 0 0)、 WC (Hy ÷ 2 2 0 0)、 NbC(Hy ÷ 2 4 0 0)、 WC (Hy ÷ 2 2 0 0)、

TaC (H_V ÷ 1 8 0 0) 、 Cr₃C₂(H_V ± 1 3 0 0) 、TiN (H_V ÷ 2 4 0 0) 、VN (H_V ÷ 1 5 0 0) 、 2_rN (H_V ÷ 1 9 0 0) 、A₂C₃(H_V ÷ 2 1 0 0) 、 2_rO (H_V ÷ 2 2 0 0) 等が適用でき、粒度は 2 0 0 ~ 8 0 0 * が超ましく、媒体に対しては 1 ~ 1 0 % 程度混入させるのが好ましい。なお、被処理物の材質としては、上記の実施例に示すもののほかに、 1.0 % の高炭素料、 SUS 420J₁、SUS 420J₂ 等にも好ましく適用できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(d)は冷凍圧縮機や空気圧縮機に用いられる弁形状の代表例を示す図で、第1図(a)~(d)はそれぞれのA矢視図、第2図はリング弁の弁機構の主要構造を示す図、第3図はリード弁の弁機構の主要構造を示す図、第4図は本発明の実施例で得られた環状弁の表面の金属組織を示す類微鏡写真である。

復代理人 内田 明復代理人 萩原 免、一



-453-

手続補正書(方式)

昭和 5 8 年 3 月 / 日

特許庁長官 若杉和夫殿

- 1. 事件の表示 昭和 5.7 年特許顯第 173954号
- 2. 発明の名称 表面処理方法
- 補正をする者
 事件との関係 特許出願人

fi 所 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

4. 旗代 理 人

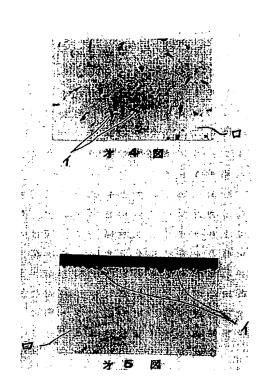
年 所 東京都港区虎ノ門一丁目24番11号

第三岡田ビル 電話 (504) 1894番 氏名 介理士 (7179) 内 田 (

4番 明 (ほか1名)

5. 補正命令の日付 昭和58年2月22日(発送日)

6. 補正により増加する発明の数 な し



7. 補正の対象

- (1) 明細書の発明の詳細な説明
- (2) 明細書の図面の簡単な説明
- (3) 図面(図番)

B. 補正の内容

- (1) 明細書 3 頁 1 3 ~ 1 4 行の「第 1 図(a) ~ (d)」を「第 1 図(e) ~ (h)」と訂正する。
- (2) 同8頁12~13行の「第1図(a)~(d)」を 「第1図(e)~(h)」と訂正する。
- (3) 第 1 図 (a) ~ (d) の図番を別紙朱書の通りに訂 . 正する。

